



ЗАТВЕРДИТИ

Освітній рівень: МАГІСТР

підготовки

МАГІСТРА

Освітня кваліфікація: Магістр прикладної фізики та нанотехнологій

Професійна кваліфікація: Фізик з розробки, проектування і керування технологічними процесами

Термін навчання - 1 рік, 4 місяці
(включаючи семестр)

На базі диплома бакалавра, спеціальність, магістра
(за спеціальною угодою про навчання)

Освітньо-професійна програма: Прикладна фізика

Форма навчання: ДЕННА

Проктор: Ірина Мосько А.В.
2020 р.

		Графік навчального процесу																	Видові днів по використанню часу (тижнями)								
кв.	кв.	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Листопад	Серпень	Територіальні заняття		Підприємства		Навчальні заняття		Науково-дослідницькі роботи		Всього					
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11					
		Т	С	Н	П	А	Д	К	Л	С	С	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К				
1	2																										
2	3																										

		План навчального процесу																									
№ дисципліни	НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ	Семестровий контроль					Семестр	Навчальні заняття						Семестр	Тривалість семестру (тижнів)												
		Екзамени	Зачеки	Пробні іспити	Курсові роботи (парові)	Проекти		Аудиторні години	Тисячі аудиторних годин		Самостійна робота		1 курс			2 курс		3 курс									
							Всього кредитів		Лекції	Лекції	Лекції (семінари)	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції	Лекції
1. Півріч загальної підготовки																											
1	Інтелектуальна власність	1				60	2	18	18																		
2	Наукова комунікація (іноземною мовою)	2				90	3	24	24																		
3	Проблеми сучасної фізики та організації наукових досліджень в галузі	3				150	5	44	22	22																	
4	Прикладні комп'ютерні програми	1				120	4	36	12	24																	
5	Технології дистанційного навчання	2				120	4	44	16	28																	
6	Автоматизовані системи збору даних	1				150	5	54	26	28																	
7	Магістерський семінар (тематика затверджується на навчальній раді)	3				90	3	24	24																		
Всього годин за навчальний процес						780	26	244	118	46	80	0	52	484	6	4	8,5	56	52	16	52	46	22	22	22	22	22
Всього кредитів за навчальний процес						3	4											11	7								
2. Півріч професійної підготовки																											
1	Астрофізика	1				120	4	44	26	18																	
2	Фізика напівровідників	1				150	5	54	36	18																	
4	Фізика наноструктур	1				150	5	54	28	26																	
4	Елементи напівровідникових процесів	2				120	4	42	24	18																	
5	Фотонні пристрої і сенсори	3				120	4	36	20	16																	
6	Програмування мікроконтролерних систем	2				150	5	56	22	34																	
7	Практика на виробничій	2,3				240	8	0																			
8	Переддипломна практика	3			3	180	6	0																			
Разом						1230	41	286	156	26	104	0	80	864	6	6	4,5	90	62	46	52	20	16	16	16	16	16
Всього годин за навчальний процес						41												14	11								
3. Півріч вибіркової дисципліни																											
1	Вибіркова дисципліна 1.	1				150	5	54	36	38																	
2	Вибіркова дисципліна 2.	2				120	4	42	24	18																	
3	Вибіркова дисципліна 3.	2				120	4	44	12	32																	
4	Вибіркова дисципліна 4.	2				150	5	52	34	18																	
5	Вибіркова дисципліна 5.	3				150	5	44	22	22																	
Разом						690	23	236	108	18	110	0	46	408	3	8	5,5	16	38	70	68	22	22	22	22	22	22
Всього кредитів за навчальний процес						0	5											5	13								
Всього годин за навчальний процес (всього)						2700	90	766	382	90	294	0	178	1756	17,5	18	18,5	162	152	132	172	88	60	60	60	60	60
Загальна підготовка						780	26	244	118	46	80	0	52	484	6	4	8,5	56	52	16	52	46	22	22	22	22	22
Професійна підготовка						1230	41	286	156	26	104	0	80	864	6	6	4,5	90	62	46	52	20	16	16	16	16	16
Вибіркова дисципліна						690	23	236	108	18	110	0	46	408	3	8	5,5	16	38	70	68	22	22	22	22	22	22
Кількість кредитів						3											3	5									
Кількість годин																											
Кількість кредитів																											
Кількість годин																											

Начальна		Вибіркова	
Назва практики	Термін проведення Семестр	Назва практики	Термін проведення Семестр
Практика на виробничій	2	Практика на виробничій	3
		Переддипломна практика	3
			4

Державна атестація		
№ за порядком	Форма і зміст підручної атестації	Семестр
1	Магістерська робота	3

Навчальний план складено у відповідності до _____ (назва стандарту, за наявності)

а також згідно з _____ (назва професійного стандарту, за наявності)

1. Закладучи кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірних технологій Федюка С.А.

Закладучи кафедри теоретичної та математичної фізики імені А.В.Сидінського Сакнон В.С.

Затверджено на засіданні Вченої ради навчально-наукового фізико-технологічного інституту

Протокол № 1 від "14" травня 2020 року

Директор навчально-наукового фізико-технологічного інституту Мирончук Г.Л.

Погоджено
Навчальний план викладачів
14 05 2020

Погоджено
Пректор з навчальної роботи та рекрутації
14 05 2020

Затверджено
Рішенням Вченої ради
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
18 05 2020